

-1-

ACCESSION NUMBER
TITLE
PATENT APPLICANT
INVENTORS
PATENT NUMBER
APPLICATION DETAILS
SOURCE

84-138461
LIQUID JET RECORDING APPARATUS
(2000100) CANON INC
HARA, TOSHITAMI; YANO, YASUHIRO; HARUTA, MASAHIRO
84.08.08 J59138461, JP 59-138461
83.01.28 83JP-012444, 58-12444
84.12.07 SECT. M, SECTION NO. 343; VOL. 8, NO. 267,
PG. 34.

INT'L PATENT CLASS
JAPIO CLASS
FIXED KEYWORD CLASS
ABSTRACT

B41J-003/04
29.4 (PRECISION INSTRUMENTS--Business Machines)
R105 (INFORMATION PROCESSING--Ink Jet Printers)
PURPOSE: To record an image increased in the
faithfulness of the response to a recording signal
and high in resolving power and quality at a high
speed in a liquid jet recording apparatus, by
providing an opening separate from an emitting port
on a liquid flowline.
CONSTITUTION: An opening 119 separate from an orifice
108 is provided in order to prevent the
non-stabilization in the emission of a liquid from
the orifice caused by such a state that air bubbles
are stayed in the deep part (in the vicinity of a
front wall plate 103) of a liquid flowline 118 during
ink filling and achieves an auxiliary function for
venting a part of air present in the liquid flowline
during ink filling and not venting only from the
orifice 108. The liquid flowline between the orifice
108 and the opening 119 efficiently performs the
emission of the liquid from the orifice 108 and, in
order to prevent the emission of the liquid from the
opening 119 when heat energy is imparted to the
liquid from the heat acting surface 115, the shape of
a partition wall 117 may be determined so as to make
the liquid flowline narrow. One or more of the
opening 119 is usually provided to the deepest part
of the liquid flowline, that is, in close vicinity of
the front wall plate 103 and the diameter thereof is
pref. made smaller than that of the orifice 108.

Int. Cl.³
B 41 J 3/04

識別記号
1 0 3

庁内整理番号
7810-2C

43公開 昭和59年(1984)8月8日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

④液体噴射記録装置

①特 願 昭58-12444
②出 願 昭58(1983)1月28日
③発 明 者 原利民
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内
④発 明 者 矢野泰弘
東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キャノン株式会社内
⑤発 明 者 春田昌宏
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内
⑥出 願 人 キャノン株式会社
東京都大田区下丸子3丁目30番
2号
⑦代 理 人 弁理士 若林忠

明 細 書

1. 発明の名称

液体噴射記録装置

2. 特許請求の範囲

1. 熱エネルギーの利用によって液体を吐出し炭素の炭素を形成するために設けられた複数の吐出出口と、これ等の吐出出口に流通し、前記炭素の炭素を形成するための液体が供給される炭素室と、炭素室に前記液体を供給するための供給口と、前記吐出出口のそれぞれに対応して設けられた、前記熱エネルギーを発生する手段としての複数の電気炭素変換体とを具備し、炭素室の炭素室のそれぞれは、発生される熱エネルギーが前記炭素に作用する炭素としての炭素作用面を前記炭素室の炭素面に有し、前記吐出出口のそれぞれは、炭素面に近い所かいて設けられ、前記炭素室内に、それぞれ隣接する炭素作用面及び吐出出口間を隔離する隔壁電が設けられ、それぞれの吐出出口毎に前記炭素の炭素室を有する液体噴射記録装置に於いて、前記炭素室上に吐出出口とは別の

炭素を2の開口が設けられてなることを特徴とする液体噴射記録装置。

2. 前記吐出出口とそれに対応する炭素室の2の開口との間の炭素室が狭げられてなる特許請求の炭素室1項記載の液体噴射記録装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、吐出出口より炭素を吐出することによって形成された炭素の炭素を用いて記録を行う液体噴射記録装置、特に熱エネルギーを利用する液体噴射記録装置に関する。

液体噴射記録装置には、種々の方式があるが、その中でも、例えば特開公報(OL5)2944005号公報に開示された液体噴射記録装置は、炭素カラム記録が特徴であって、その出力部の主要部である記録ヘッドは、記録用の炭素を吐出して、炭素の炭素を形成するための吐出出口(オリフィス)を高密度に配列することができるために、高解像力を得ることができると同時に、記録ヘッドとして全体的にはコンパクト化が計れ、且つ炭素に向くこと、更には半導体分野において技術の進歩と

を施して直電されることによって、液体の電極の間の熱発生部118で熱エネルギーを発生する。熱作用面115は、発生した熱が液体に作用するところであり、熱発生部118と密接な関係がある。この熱作用面115での熱作用により液体中にバブルが発生し、その圧力エネルギーにより液体中にバブルが発生し、その圧力エネルギーにより液体がオリフィス108から飛翔的飛出となって吐出され記録が実施される。

電圧変換体102のそれぞれを記録信号に従って駆動させて所定のオリフィス108から液体を吐出させるには、選択される選択電極112と共通電極114とを通じて印加電圧を供給することによって実施される。

以上説明した従前の液体噴射記録装置の構成に加え、本発明の液体噴射記録装置に於いては、それぞれの飛出路上に、オリフィス108とは別の第2の開口119が設けられる。

この第2の開口119は、前述したインク結の時に飛出路118の奥（前吸板103の近傍）に空気

が飛出ることによるオリフィスから飛出中の不安定化を防止するために設けられるもので、インク結の際に飛出路内に存在する空気はオリフィス108からだけでは抜けない部分を抜く補助的な役割を果たす。

第4図は第1～3図に示した液体噴射記録装置の飛出路部分の部分拡大図であり、オリフィス108と第2の開口119との間の飛出路は、オリフィスからの液体吐出を効果的に行ない、かつ熱作用面115から液体に熱エネルギーが与えられた際に第2の開口から液体吐出が生じないようにするために、この第4図に示されるように狭げられるよう隔離壁117の形状を定めるのがよい。

第2の開口119は、一般に飛出路の最も奥、すなわち前吸板103に近接して、1個以上設けられ、その径はオリフィス108より小さいものであることが好ましい。

第5a図及び第5b図は、本発明の液体噴射記録装置における隔離壁117及び第2の開口119の設置様式の好適な変形例を示した模式図である。

以下、本発明を実施例に従ってより具体的に説明する。

実施例1

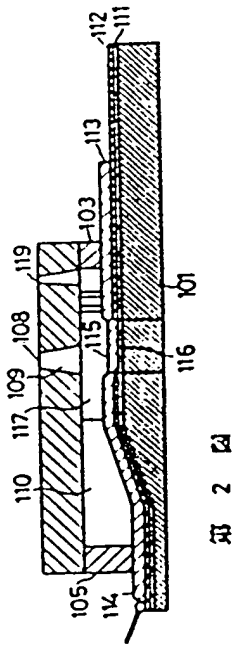
上面を熱酸化して SiO_2 層を2 μm 厚に形成したSi基板をエッチングにより共通電極部分として100 μm 取り除いた。次に発熱抵抗層としてTa層を2000 \AA 厚、電極としてAl層を1 μm 厚に形成した後、フォトリソ工程により形状80 $\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$ の熱発生部（ヒーター）アレーを125 μm ピッチで形成した。また、Ta層の酸化防止及びインク液の浸透防止、液体が熱エネルギーを受けた際に発生されるバブルによる耐機械的衝撃用の膜として、 SiO_2 層0.5 μm 厚、SiC層1 μm 厚を順次スパッタリングにより形成して保護層を形成した。

次にこの基板上に第1～4図で示されるような幅さが30 μm の隔離壁、前吸板、後吸板、二つの側吸板、オリフィス板及び供給管を設置し液体噴射記録装置を作製した。隔離壁で仕切られる飛出路の幅は、広い部分で80 μm 、狭い部分で20 μm であり、共通電極（ここでは隔離壁で仕切られてい

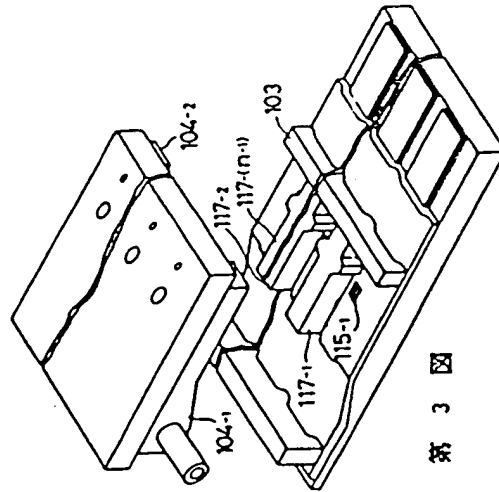
る飛出路部分は含まない）と熱作用面間の距離は800 μm 、熱作用面と飛出路幅が20 μm になる部分までの距離は50 μm 、飛出路幅が20 μm の部分の長さは50 μm 、第2の開口が設けられる第4図右側の部分は幅20 μm 、長さ100 μm であった。オリフィス板は30 μm 厚のニクロム板からなり、エッチングにより40 μm 径のオリフィスがそれぞれの熱作用面の中央の直上から50 μm 共通電極側に位置し、20 μm 径の第2の開口がそれぞれの飛出路の奥から25 μm のところへ位置するように形成されている。

この液体噴射記録装置に対して8 μsec の矩形電圧を与えて駆動させた。この場合の液体吐出の最高周波数応答f_{max}は7kHzであり、各オリフィス間の液体吐出のパラッキはなかった。また、吐出スピードも各オリフィスで120 μsec とほぼ均一であり、第2の開口からは、液体の吐出は全く生じなかった。

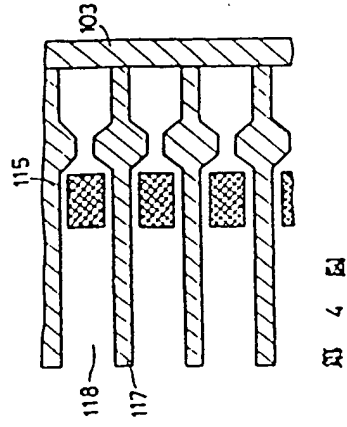
他方、第2の開口がなく、他は全く同様にして製作された液体噴射記録装置に対して同様な吐出試験を実施したところ、各オリフィス間で最高周



第 2 図



第 3 図



第 4 図